

半导体水浴恒温槽



Semiconductor Water Bath
Constant Temperature Bath

产品简述

VMS - TEB - ***L 系列的半导体水浴恒温槽整机采用先进的内循环 / 外循环泵系统。内循环通过半导体制冷器和先进的 PID 控温程序保证内腔温度均匀恒定，外循环泵可以把槽内恒温液体的热量引到第二恒温场。产品采用高亮 SUS304 不锈钢结构，具备高耐蚀性，更适用洁净室使用；该系列产品具有较高的 COP，高，低功耗，高性能，控制精度高，内置液检测开关及多种报警装置，安全耐用，运行数据和报警信息可以同步上传到 PC 系统。

主要优势

- 紧凑设计
- 高可靠性
- 精准控温
- 可编程
- 超低噪音
- 符合 Rohs 要求

应用领域

- 医疗分析 & 试验设备
- 化学分析
- 生物工程
- 医药卫生
- 半导体气相沉积（CVD）
- 化学 / 原子沉积系统
- 超导磁共振、微波治疗机

半导体水浴恒温槽产品阵容

参数事项	规格		
图示			
型号	VMS - TEB - 10L	VMS - TEB - 23L	VMS - TEB - 06L
冷却方式	帕尔贴 / 水冷式	帕尔贴 / 水冷式	帕尔贴 / 水冷式
布置方式	一体式	一体式	分体式
制冷量*	150 W (25°C 水时)	350W (25°C 水时)	140 W (25°C 水时)
尺寸 (宽 x 深 x 高)	266 x 376 x 400 mm	350 x 510 x 400 mm	储液罐 240 x 240 x 350 mm 控制器 220 x 330 x 123 mm
槽容量 (宽 x 深 x 高)	216 x 216 x 250 mm	300 x 350 x 250 mm	ø170 x 202 mm
重量	约 15.5 kg	约 21 kg	储液罐 / 控制器 : 约 12 kg / 5kg
电源电压范围	100 VAC - 240 VAC	100 VAC - 240 VAC	100 VAC - 240 VAC
额定电流 (AC100时)	4 A	5.5 A	3.5 A
液体温度范围	0 - 60°C	0 - 60°C	0 - 60°C
温度稳定性	± 0.03°C	± 0.03°C	± 0.03°C
通信接口	RS-485 / RS-232C	RS-485 / RS-232C	RS-485 / RS-232C
安全标准	3C / RoHS	3C / RoHS	3C / RoHS